

[기술명] 열전 박막을 이용한 열화학 가스 센서 및 그 제조방법

[연구자 명] 좌용호

[소속] 재료화학공학과

기술분류

○ IT ○ BT ● NT ○ ET ○ ST ○ CT ○ 기타

키워드

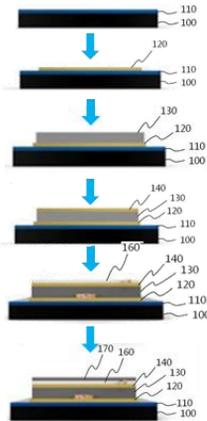
열전 박막, 가스 센서, 열화학 센서, 소형화, 촉매층

지식재산권 현황

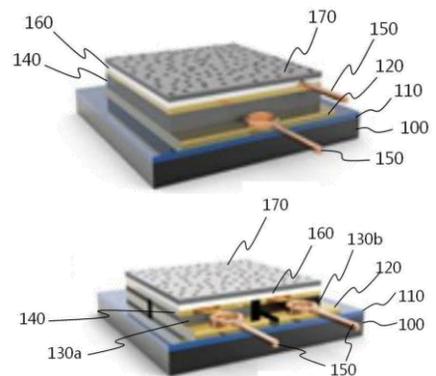
No	발명의 명칭	특허번호	출원인	발명자
1	열전 박막을 이용한 열화학 가스 센서 및 그 제조 방법	10-1906153	한양대학교 에리카	좌용호

기술 개요

- ❖ 본 기술은 열전 박막을 이용한 열화학 가스 센서에 관한 기술
- ❖ 본 기술은 감지하고자 하는 가스와 선택적으로 반응하는 촉매의 변화를 통해 원하는 종류의 다양한 가스를 감지할 수 있는 열화학 가스 센서 및 그 제조 방법을 제공할 수 있음



[열화학 가스 센서의 제조 방법]



[열화학 가스 센서의 구조 예]

